

# 原理から学ぶ機器分析【3】 X線分析2・X線回折

【日時】 2017/5/25 (木) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部第3講義室 (西講義棟3F)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社リガク

## 13:00-14:30 基礎から学ぶX線回折

X線とは? から始まり、ミラー指数や結晶構造、汎用的なX線回折装置、粉末X線回折測定の実験・ノウハウなど、基礎から分かりやすく解説します。

## 14:40-15:50 薄膜・残留応力X線分析、小角散乱測定的基础

薄膜材料の高感度測定、反射率測定、残留応力測定、小角散乱測定について、基礎と解析例をご紹介します。

## 16:00-17:00 ここまでできるX線回折 ～最新の応用例まで～

in-situ測定、微小部測定、結晶子サイズ・粒径解析、リートベルト法を用いた評価など、X線回折を利用した各評価の基本的な内容から最新の応用例までをご紹介します。

近年、分析装置の操作性は格段に向上し、マウス一つで操作が完結する場合も珍しくありません。一方、機器の原理が曖昧なままでもデータが取得でき、その解釈を誤るという危険性ははらんでいます。今年度のセミナーは、基本に立ち返り、原理をよく理解してより良いデータを取得し、正しい解釈ができることを目指します。

今回は、材料の評価に有用なX線回折について基礎から応用まで幅広く知識が得られる内容です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 Tel.092-802-2857  
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp